

CTLD热释光剂量测量系统辅助设备



CTLD-T200热释光探测器退火炉

CTLD-T200型精密热释光探测器退火炉是对热释光探测器进行热处理的专用设备，用于热释光探测器使用前和照射后的热处理（退火）。

- ◇ 电容式触摸按键
- ◇ 表面温度： $\leq 60^{\circ}\text{C}$ (400°C)
- ◇ 温度：从室温到 400°C 连续可调
- ◇ 报警功能：超过设定温度 5°C 时自动报警
- ◇ 升温时间： $240^{\circ}\text{C} \leq 35\text{min}$
- ◇ $400^{\circ}\text{C} \leq 90\text{min}$
- ◇ 炉腔尺寸： $\phi 1300\text{mm} \times 42\text{mm}$
- ◇ $\phi 140\text{mm} \times 42\text{mm}$
- ◇ 控温精度： $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
- ◇ $\phi 150\text{mm} \times 42\text{mm}$
- ◇ 工作方式：连续工作



CTLD-T300热释光探测器退火炉

CTLD-T300型精密热释光探测器退火炉是对热释光探测器进行热处理的专用设备，用于热释光探测器使用前和照射后的热处理（退火）。

- ◇ 电容式触摸按键
- ◇ 表面温度： $\leq 50^{\circ}\text{C}$ (400°C)
- ◇ 温度：从室温到 400°C 连续可调
- ◇ 工作方式：连续工作
- ◇ 控温精度： $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
- ◇ 报警功能：超过设定温度 5°C 时自动报警
- ◇ 升温时间： $240^{\circ}\text{C} \leq 35\text{min}$
- ◇ $400^{\circ}\text{C} \leq 90\text{min}$
- ◇ 热室有效尺寸： $132\text{mm} \times 180\text{mm} \times 50\text{mm}$
- ◇ 冷却室有效尺寸： $150\text{mm} \times 200\text{mm} \times 70\text{mm}$



CTLD-L200热释光探测器退火冷却炉

CTLD-L200热释光探测器冷却炉是热释光探测器退火的配套设备，用于热释光探测器退火后的冷却。

- ◇ 半导体制冷
- ◇ 降温速度：室温降至 $0^{\circ}\text{C} \leq 30\text{min}$
- ◇ 电容式触摸按键
- ◇ 工作方式：连续工作
- ◇ 控温范围：从室温到 0°C 连续可调
- ◇ 退火炉外形尺寸： $300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 370\text{mm}$
- ◇ 温度显示：数码显示
- ◇ 控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ◇ 冷却板尺寸： $250\text{mm} \times 250\text{mm}$



CTLD-热释光探测器低本底铅室

CTLD系列热释光探测器低本底铅室是热释光剂量测量系统的配套产品，用于热释光剂量计、热释光探测器照射后及热处理后的存放。

- ◇ 结构：上侧开门
- ◇ 本底：CTLD-D2000A： $\leq 5\text{cps}$
- ◇ CTLD-D2000B： $\leq 3\text{ps}$ (同NaI探头)
- ◇ CTLD-D2000C： $\leq 5\text{cps}$ (50mm)
- ◇ $\leq 3\text{cps}$ (100mm)